

## 利用料金表 (NIMS 内部利用)

2023年4月より適用

装置名	利用形態	課金単位 機器利用・技術補助 (技術代行=0.25h)	利用料金 (1hあたり) 税込				
			機器利用	技術補助	技術代行1	技術代行2	技術代行3
実動環境対応物理分析電子顕微鏡 <b>JEM-ARM200F-G</b>	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	6,600	9,075	9,322	11,550	14,025
実動環境対応電子線ホログラフィー電子顕微鏡 <b>JEM-ARM200F-B</b>	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	6,600	9,075	9,322	11,550	14,025
200kV電界放出形透過電子顕微鏡 <b>JEM-2100F1, JEM-2100F2</b>	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	3,300	5,775	6,022	8,250	10,725
200kV透過電子顕微鏡 <b>JEM-2100</b>	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	1,650	4,125	4,372	6,600	9,075
2軸傾斜バイアス印加・加熱TEM試料ホルダー <b>Lightning</b>	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	1,650	4,125	4,372	6,600	9,075
2軸傾斜液体窒素冷却TEM試料ホルダー <b>Gatan 636</b>	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	1,650	4,125	4,372	6,600	9,075
走査型電子顕微鏡 <b>JSM-7000F</b>	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	—	—	4,372	6,600	9,075
デュアルビーム加工観察装置 <b>NB5000</b>	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	4,950	7,425	7,672	9,900	12,375
FIB/SEM精密微細加工装置 <b>Helios 650</b>	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	3,300	5,775	6,022	8,250	10,725
FIB加工装置 <b>JIB-4000, JEM-9320FIB</b>	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	1,650	4,125	4,372	6,600	9,075
FIB加工装置 <b>ピックアップシステム</b>	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	0.25h	1,650	4,125	4,372	6,600	9,075
ウルトラマイクロトーム <b>Leica EM UC6</b>	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	1h	1,650	4,125	4,372	6,600	9,075
<b>HRTEM解析システム</b>	技術補助・技術代行 共同研究	1h	—	4,125	4,372	6,600	9,075
<b>電子線トモグラフィー解析システム</b>	技術補助・技術代行 共同研究	1h	—	4,125	4,372	6,600	9,075
<b>DPC解析システム</b>	技術補助・技術代行 共同研究	1h	—	4,125	4,372	6,600	9,075
<b>TEM試料作製装置群</b>	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	機器利用=1h 技術補助=0.25h	1,650	4,125	4,372	6,600	9,075

※技術代行の料金設定は、難易度によって3種類に分かれています  
標準的な作業の場合は2が適用されます